

半導体検査、水分の分布可視化、
食品の異物検査に。
SWIR 画像を
イメージスキャナ方式で。

※ 製品改良のため仕様・外観等は予告なく変更となる場合がございます。



イメージスキャナ方式の強み

- 基準板による校正機構搭載
反射率、透過率(オプション) 2次元分布解析に。
- 照射角度、受光角度が一定
光沢素材でもテカリの無い画像に。

応用事例

- 半導体ウェハの均一性評価
- 水分分布を2次元で可視化
- 広範囲を一括撮影、異物検査



基本仕様

● モデル 1 : SWIR 専用機

光源	SWIR (例 $\lambda=1050 / 1300 / 1550 \text{ nm}$)
階調	12bit 入力 / 16bit 出力
取込寸法	310 mm × 420 mm
光学解像度	211 ppi (総画素数: 900 万画素)
オプション	透過モード

● モデル 2 : SWIR 専用機 (HDR)

光源	SWIR (例 $\lambda=1050 / 1300 / 1550 \text{ nm}$)
階調	14bit 入力 / 16bit 出力
取込寸法	310 mm × 420 mm
光学解像度	168 ppi (総画素数: 570 万画素)
オプション	透過モード

● モデル 3 : 2ch-SWIR 専用機

光源	SWIR (例 $\lambda_1=1300 \text{ nm} / \lambda_2=1550 \text{ nm}$)
階調	12bit 入力 / 16bit 出力
取込寸法	310 mm × 420 mm
光学解像度	SWIR (λ_1): 84 ppi (総画素数: 140 万画素) SWIR (λ_2): 84 ppi (総画素数: 140 万画素)
オプション	透過モード

● モデル 4 : フルカラー / SWIR マルチモード機

光源	白色 / SWIR (例 $\lambda=1050 / 1300 / 1550 \text{ nm}$)
階調	各色 12 bit 入力 / 16bit 出力
取込寸法	310 mm × 420 mm
光学解像度	可視: 280 ppi (総画素数: 1600 万画素) SWIR: 84 ppi (総画素数: 140 万画素)
オプション	透過モード